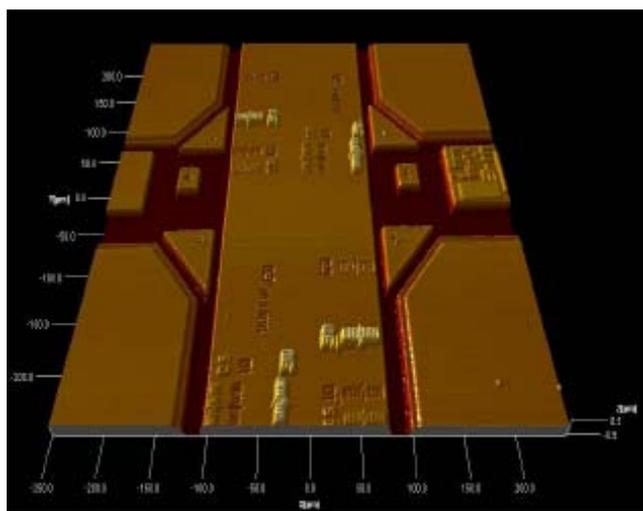
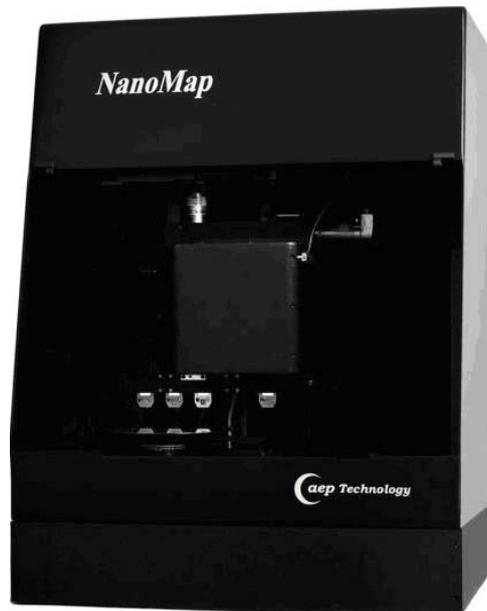


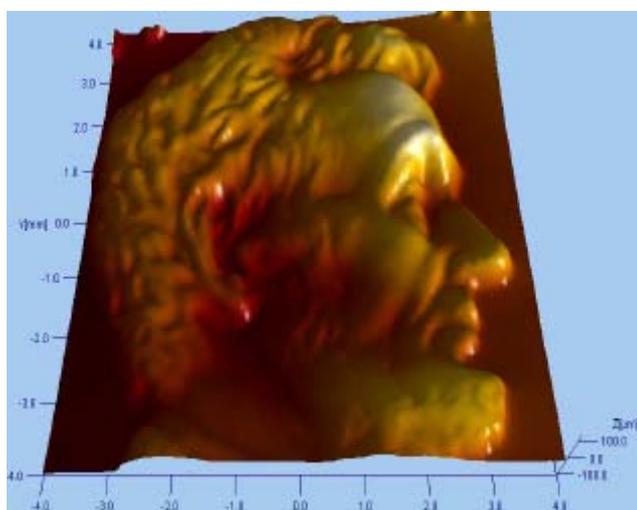
NanoMap 500LS 扫描三维表面轮廓仪

特点

- 常规的接触式轮廓仪和扫描探针显微镜技术的完美结合。
- 双模式操作（针尖扫描和样品台扫描），即使在长程测量时也可以得到最优化的小区域三维测图。
- 针尖扫描采用精确的压电陶瓷驱动扫描模式，三维扫描范围从 $10\ \mu\text{m} \times 10\ \mu\text{m}$ 到 $500\ \mu\text{m} \times 500\ \mu\text{m}$ 。样品台扫描使用高级别光学参考平台能使长程扫描范围到 50mm。
- 在扫描过程中结合彩色光学照相机可对样品直接观察。
- 针尖扫描采用双光学传感器，同时拥有宽阔测量动态范围（最大至 $500\ \mu\text{m}$ ）及亚纳米级垂直分辨率（最小 $0.1\ \text{nm}$ ）
- 软件设置恒定微力接触。
- 简单的 2 步关键操作，友好的软件操作界面。



IC Structure on Silicon
X, Y: $\pm 250\ \mu\text{m}$ Scan, Depth Z range $\pm 0.5\ \mu\text{m}$



北京办事处:

北京海淀中关村南大街, 100086

电话: 010-51582312

传真: 86-10-51582312

应用

- ◇ 三维表面轮廓测量和粗糙度测量，即适用于精密抛光的光学表面也可适用于质地粗糙的机加工零件。
- ◇ 薄膜和厚膜的台阶高度测量。
- ◇ 划痕形貌，磨损深度、宽度和体积定量测量。
- ◇ 空间分析和表面纹理表征。
- ◇ 平面度和曲率测量。
- ◇ 二维薄膜应力测量。
- ◇ 微电子表面分析和 MEMS 表征。
- ◇ 表面质量和缺陷检测。

环境要求

- 湿度: 10-80%，相对湿度，无冷凝
- 温度: 65-85 华氏度 ($\Delta T < 1$ 度/小时)
- 电源要求: 110/240V, 50/60 Hz

Lincoln Head on US Penny
X, Y: $\pm 4\ \text{mm}$ Scan, Depth Z range 239um

技术规格

类型	项目	规格
综述	小范围 XY 扫描头, 提供高精度	
	XY 平台扫描, 提供大尺度测量	
	带亮场和暗场的全时彩色 CCD 照相机	
	软件控制触针测量力, 范围	0.1-100mg
	触针针尖半径选项	2.5 μ m, 5 μ m, 12.5 μ m 和 25 μ m, 0.1-0.8 μ m 可选
针尖扫描 (Piezo 扫描器)	台阶高度重现性	0.6nm
	垂直分辨率	0.1nm
	测量高度精细范围	5 μ m
	测量高度粗略范围	0.5mm
	XY 扫描分辨率	0.1 μ m
	XY 扫描定位重现性	0.2 μ m
	扫描速度	10-50 μ m/sec
	扫描范围	10-500 μ m
	每次扫描数据点	100-1000 数据点
样品台扫描	XY 样品区域	150mm x 150mm 250mm 安装空隙
	XY 平台运动范围	150mm X 150mm
	XY 平台定位重现性	5 μ m
	最大扫描长度	150mm
	扫描速度	0.1-5mm/sec
	Z 平台范围	55mm
	最大样品高度	50mm
	手动旋转平台范围	360 度
	手动倾斜平台范围	\pm 4 度
标准样品	台阶高度标准样品 (NIST 认证)	100 μ m;
系统	光学照相机视场范围	1.5 X 1.5mm
	光学照明	软件控制暗场和亮场
	电脑	Pentium IV, USB2.0 联接
	操作系统	Win XP
	系统动力需求	90-240V, 350W
	空间尺寸	20" 宽 X 22"长 X 25"高
	重量	160lb

北京办事处:

北京海淀中关村南大街, 100086

电话: 010-51582312

传真: 86-10-51582312